

CA	Poniedziałek			Wtorek			Środa			Czwartek			Piątek		
	01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03	01	02	03
7 - 8															
8 - 9	Control theory L1, L2 s. 133 B4			Process engineering L1 s. 303 B4			Basics of mechatronics L1, L2 s. 133 B4			Process engineering L3 s. 303 B4			Basics of mechatronics W every 2 weeks from 8.03 s. 103 D1		
9 - 10		Control theory L3 s. 133 B4			Process engineering L2 s. 303 B4										
10 - 11				FODMIM L1, L2 every 2 weeks s. 18 D1									Process engineering W every 2 weeks s. 217 B3		
11 - 12	1.Object oriented programming languages 2. Object Oriented modeling W every 2 weeks s.104 D1														
12 - 13						FODMIM L3 every 2 weeks									
13 - 14				Foreign Language Class 1									Foreign Language Class 1		
14 - 15				Foreign Language Class 1									Foreign Language Class 1		
15 - 16	Fundamentals of design mechanisms in mechatronic devices W s. 101 B2			Foreign Language Class 1									Foreign Language Class 1		
16 - 17	Fundamentals of design mechanisms in mechatronic P1, P2 s. 101 B2			Control theory C1 s.132 B4		Control theory C2 s.132 B4			Basics of mechatronics P2 s. 133 B4		Control theory W s.2 D1				
17 - 18	Fundamentals of design mechanisms in mechatronic P1, P2 s. 101 B2			Object oriented modeling L1 od 6.03 s. 209 D1						Basics of mechatronic L3 s. 133 B4		Control theory W s.2 D1			
18 - 19	Fundamentals of design mechanisms in mechatronic P1, P2 s. 101 B2			OOPL L1 od 6.03 s. 209 D1		OOPL L2 od 6.03 s. 210 D1									
19 - 20	Fundamentals of design mechanisms in mechatronic P1, P2 s. 101 B2			OOPL L1 od 6.03 s. 209 D1		OOPL L2 od 6.03 s. 210 D1									
20 - 21	Fundamentals of design mechanisms in mechatronic P1, P2 s. 101 B2			OOPL L1 od 6.03 s. 209 D1		OOPL L2 od 6.03 s. 210 D1									
21 - 22	Fundamentals of design mechanisms in mechatronic P1, P2 s. 101 B2			OOPL L1 od 6.03 s. 209 D1		OOPL L2 od 6.03 s. 210 D1									



Zajęcia mogą NIE odbywać się co tydzień. Szczegółowy rozkład zajęć dostępny jest w systemie **Wirtualna Uczelnia**

data aktualizacji: 06.03.2018